CLIPPEDIMAGE= JP411344425A

PAT-NO: JP411344425A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 11344425 A

TITLE: DEVICE FOR ANALYZING EXHAUST GAS OF INTERNAL COMBUSTION ENGINE USING

GAS TRACE METHOD

PUBN-DATE: December 14, 1999

INVENTOR-INFORMATION:

NAME
ADACHI, MASAYUKI
SAITO, JUICHI

COUNTRY
N/A
N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY
HORIBA LTD

APPL-NO: JP10170600

APPL-DATE: June 2, 1998

INT-CL (IPC): G01N001/22

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a device for analyzing the exhaust gas of an internal combustion engine using the gas trace method.

SOLUTION: A dilution channel 6 for introducing a dilution gas for diluting a part of an exhaust gas from an exhaust channel 3 that is connected to an internal engine is connected to a sampling channel 4 for sampling a part of the exhaust gas with a constant flow rate, at the same time a trace gas is introduced at the upstream side of a connection point B of the sampling channel for the exhaust channel, and at the same time a mass flow controller 15, a trace gas detector 16 for measuring the concentration of the trace gas, and a gas analyzer 17 for measuring a measurement object component in the above exhaust gas are provided in parallel with one another at the downstream side of a dilution gas introduction point A of the sampling channel, at the same time a sample bag 20 is connected to an exhaust exit 15a of a mass flow controller, and the above diluted exhaust gas is sent to the mass flow controller, the trace as detector, and the gas analyzer.

COPYRIGHT: (C)1999, JPO

02/13/2003, EAST Version: 1.03.0002

#### (19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

# 特開平11-344425

(43)公開日 平成11年(1999)12月14日

(51) Int.Cl.\*

G01N 1/22

識別記号

ΡI

G01N 1/22

G

M

## 審査請求 未請求 請求項の数1 FD (全 5 頁)

(21)出魔番号

特質平10-170600

(71)出頭人 000155023

株式会社煽場製作所

(22)出廣日

平成10年(1998) 6月2日

京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地

(72)発明者 足立 正之

京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地

株式会社場場製作所内

(72)発明者 斉藤 壽一

京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地

株式会社堀場製作所内

(74)代理人 弁理士 藤本 英夫

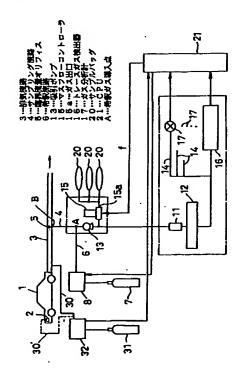
## (54) 【発明の名称】 ガストレース法を用いた内閣機関の排ガス分析装置

#### (57)【要約】

(修正有)

【課題】 ガストレース法を用いた内燃機関の排ガス分析装置を提供する。

【解決手段】 内燃機関に連なる排気流路3からの排がスの一部を定流量でサンプリングするサンプリング流路4に、前記排ガスの一部を希釈する希釈ガスを導入するための希釈流路6を接続するとともに、排気流路に対して、サンプリング流路の接続点Bより上流側においてトレースガスを導入する一方、サンプリング流路の希釈ガス導入点Aよりも下流側に、マスフローコントローラ15、トレースガスの濃度を測定するトレースガス検出器16および前記排ガス中の測定対象成分を計測するためのガス分析計17を互いに並列に設けるとともに、マスフローコントローラのガス出口15aにサンプルバッグ20を接続して、前記希釈された排ガスを、マスフローコントローラ、トレースガス検出器およびガス分析計に送り込む。



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 内燃機関に連なる排気流路からの排ガス の一部を定流量でサンプリングするサンプリング流路 に、前記排ガスの一部を希釈する希釈ガスを導入するた めの希釈流路を接続するとともに、排気流路に対して、 サンプリング流路の接続点より上流側においてトレース ガスを導入する一方、サンプリング流路の希釈ガス導入 点よりも下流側に、マスフローコントローラ、トレース ガスの濃度を測定するトレースガス検出器および前記排 ガス中の測定対象成分を計測するためのガス分析計を互 10 いに並列に設けるとともに、マスフローコントローラの ガス出口にサンプルバッグを接続して、前記希釈された 排ガスを、マスフローコントローラ、トレースガス検出 器およびガス分析計に送り込み、トレースガスの既知の 導入量とトレースガス検出器で検出されたトレースガス の濃度とに基づいて測定された前記排ガスの流量と、ガ ス分析計で測定された排ガス中の測定対象成分の濃度と から週定対象成分の排出重量を求めるよう構成する一 方、マスフローコントローラにトレースガスの濃度値を フィードバックし、このマスフローコントローラでの流 20 量調整により前記希釈された排ガスを前記排ガスの流量 に比例した流量でサンプルバッグにサンプリングするよ う構成してあることを特徴とするガストレース法を用い た内燃機関の排ガス分析装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明はガストレース法を 用いた内燃機関の排ガス分析装置に関する。

### [0002]

【従来の技術および発明が解決しようとする課題】例え 30 ば自動車のエンジンから排出されたガス(以下、排ガス という)の従来の分析装置は、排ガスの全量を、バッグ サンプリングを行うための定流量採取装置 (Constant V olume Sampler : CVS装置)の排ガス希釈用の流通管 (一般にダイリューショントンネルと呼ばれている)内 に導いて希釈ガスとしての空気(希釈空気)と混合し、 一定量のガスを収容するサンプルバッグを介して、希釈 された排ガスを排ガス分析装置に導入し、排ガス中の測 定対象成分を計測を行うように構成されているが、排ガ スの全量が流通管内に導かれるため、分析装置全体が大 40 型化する上、CVS装置を用いるバッグ法で低濃度測定 を行う場合にはCVS装置に使用する希釈ガス中の不純 物(バックグランド)は特に低くする必要から希釈空気 中の例えばCO、HC、NOx 等を効率よく取り除く大 流量の希釈空気精製装置を用いることで多大のコストを 要することになる。更に、CVS流路内での水分捕集に よる体積減少に伴う濃度誤差が生じるといった問題があ る一方で、現行あるいは将来のより厳しい排ガス規制で は、排ガス中の測定対象成分である例えばCO、HC、

ることから、測定精度の観点からしてバッグ法での測定を希釈空気を用いるCVS装置で行うこと自体にも問題があった。

【0003】この発明は、上述の事柄に留意してなされたもので、その目的は、希釈空気を用いるCVS装置で行っていたバッグ法のデータをCVS装置を用いることなく得ることができるとともに、排ガス中の測定対象成分の排出重量も求めることができるガストレース法を用いた内燃機関の排ガス分析装置を提供することである。

[0004]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、この発明は、内燃機関に連なる排気流路からの排ガ スの一部を定流量でサンプリングするサンプリング流路 に、前記排ガスの一部を希釈する希釈ガスを導入するた めの希釈流路を接続するとともに、排気流路に対して、 サンプリング流路の接続点より上流側においてトレース ガスを導入する一方、サンプリング流路の希釈ガス導入 点よりも下流側に、マスフローコントローラ、トレース ガスの濃度を測定するトレースガス検出器および前記排 ガス中の測定対象成分を計測するためのガス分析計を互 いに並列に設けるとともに、マスフローコントローラの ガス出口にサンプルバッグを接続して、前記希釈された 排ガスを、マスフローコントローラ、トレースガス検出 器およびガス分析計に送り込み、トレースガスの既知の 導入量とトレースガス検出器で検出されたトレースガス の濃度とに基づいて測定された前記排ガスの流量と、ガ ス分析計で測定された排ガス中の測定対象成分の濃度と から測定対象成分の排出重量を求めるよう構成する一 方、マスフローコントローラにトレースガスの濃度値を フィードバックし、このマスフローコントローラでの流 量調整により前記希釈された排ガスを前記排ガスの流量 に比例した流量でサンプルバッグにサンプリングするよ う構成してある。

[0005]

【発明の実施の形態】発明の実施の形態を図面を参照しながら説明する。

【0006】図1、図2において、1は自動車、2はそのエンジンである。3はエンジン2に連なるテールパイプに連結される排気流路である。4は排気流路3に接続されるサンプリング流路で、空気など希釈用ガスで希釈しない状態の排ガスをダイレクトにサンプリングするもので、排気流路3からの排ガスの一部を定流量でサンプリングするために臨界流量オリフィス5を設けている。なお、符号Bは、排気流路3とサンプリング流路4の接続点である。

【0007】6は、サンプリング流路4に排ガスの一部を希釈する希釈ガスを導入するための希釈流路で、この希釈流路6の上流側には希釈ガスとしての、例えば純粋な窒素ガス(N2)を収容したガスボンベ7が設けら

NOx 等の排出濃度が大気レベルより低くなってきてい 50 れ、その下流側には希釈された排ガスの流量を測定する

機能と制御する機能とを兼ね備えたマスフローコントロ ーラ8 (例えば、特願平9-227442号参照) が設 けられている。そして、希釈ガスを希釈流路6から希釈 ガス導入点Aを介してサンプリング流路4へ導入するこ とで、定流量でサンプリングした前記排ガスの一部が希 釈される。なお、前記マスフローコントローラ8は、流 体流量を測定するためのセンサ部と流量を制御するため の制御弁部とからなり、流体入口から流入した希釈ガス はセンサ部を介して制御弁部に至り常に設定された流量 に制御され、流体出口から流出するよう機能する。ま た、希釈ガスとしてN2 を用いたのは、排ガス中の測定 対象成分である例えばCO、HC、NOx等の校正ガス がN2 ベースであるからである。また、前記純粋な窒素 ガス(N2 )以外でも、排ガス中の測定対象成分でな く、化学的に安定で、他の共存成分と反応しないガスで あれば、例えば、純粋な空気(ボンベAir )でも希釈ガ スとして用いることができる。

【0008】30は、排気流路3に接続されるトレース ガス供給路で、このトレースガス供給路30の上流側に はトレースガスとしての純粋なヘリウムガスを収容した 20 ガスボンベ31が設けられ、その下流側にはトレースガ スの流量を測定する機能と制御する機能とを兼ね備えた マスフローコントローラ32が設けられている。 なお、 トレースガスとしてヘリウムガスを用いた理由は、ヘリ ウムの原子量がアルゴン等の他の不活性ガスに比して排 ガス中に存在する物質の原子量とかけ離れており、質量 分析計(後述するトレースガス検出器16)を用いて干 渉なく濃度計測できることと、化学的に安定で、他の共 存成分と反応しないことによる。また、9は希釈流路6 調整器である。

【0009】前記サンプリング流路4には、例えば次の ような機器や装置が接続されている。すなわち、前記希 釈ガス導入点Aよりも下流側に、マスフローコントロー ラ15、トレースガスの濃度を測定するトレースガス検 出器16および排ガス中の測定対象成分を計測するため の複数のガス分析計17が互いに並列に設けられてい る。このガス分析計17は例えばCO、CO2、HC. NOx 等排ガス中に含まれる成分を適宜測定できるよう にサンプリング流路4から分岐する分岐流路14を介し 40 ら10倍以下の値にできる。 て設けられている。13は希釈ガス導入点Aの直下流に 設けた吸引ポンプ、11はフィルタ、12は電子冷却器 等の除湿装置である。前記吸引ポンプ13と臨界流量オ リフィス5の組み合わせにより排気流路からの排ガスの 一部を定流量でサンプリングできる。

【0010】20は、マスフローコントローラ15のガ ス出口15aに接続される複数のサンプルバッグであ る。このサンプルバッグ20には、マスフローコントロ ーラ15を介して希釈された排ガスが一定時間収容さ れ、その平均濃度と体積より例えばCO, COz, H

C. NOx 等排ガス中に含まれる成分の排出重量(モー ダルマス)を測定できる。 すなわち、 希釈空気を用いる CVS装置で行っていたバッグ法のデータをCVS装置 を用いることなく得ることができる。

【0011】そのため、この発明では、マスフローコン トローラ15にトレースガス (ヘリウムガス) の濃度値 をフィードバックし、このマスフローコントローラ15 での流量調整により希釈された排ガスを排ガスの流量Q og(t) に比例した流量でサンプルバッグ20にサンプリ 10 ングするよう構成している。

【0012】21はCPUで、マスフローコントローラ 32、トレースガス検出器16、複数のガス分析計17 からの出力信号が入力するとともに、トレースガスの既 知の導入量とトレースガスの濃度とに基づいて排ガスの 流量QDE(t)を演算し、この排ガスの流量QDE(t)に応 じた流量制御信号 f をマスフローコントローラ15に出 力して排ガスの流量QDE(t)に比例した流量がマスフロ ーコントローラ15を介してサンプルバッグ20にサン プリングされる。なお、前記排ガスの流量QDE(t)は、 CPU21においてトレースガスの既知の導入量をトレ ースガス検出器16で検出されたトレースガスの濃度で 除することによりリアルタイムで求めることができる。 【0013】更に、この発明では、排気流路3中の排が スの全量を希釈するのではなく排ガスの一部を定流量で サンプリングし、このサンプリングした排ガスを希釈流 路6に設けた臨界流量オリフィス9を介して希釈ガスで 希釈し、しかもこの希釈時においてサンプルバッグ20 内で排ガスの水分が液化しない程度にN2 で希釈できる よう、CPU21にガソリン車、ディーゼル車等に応じ に設けた臨界流量オリフィスである。また、10は圧力 30 た希釈率を予め入力しているので、希釈空気を用いるC VS装置で行っていたバッグ法で問題となっていた水分 捕集による体積減少に伴う濃度誤差を考慮する必要がな くなった。例えば、ガソリン車では排ガスの一部の希釈 率を10倍とした場合、排ガスの一部は排気流路3から 接続点Bを介してサンプリング流路4に定流量でサンプ リングされるから、この排ガス流量を10倍した流量の 希釈ガスが希釈流路6から希釈ガス導入点Aを介してサ ンプリング流路4に導入される。また、ディーゼル車で は排ガス中の水分がガソリン車の場合に比して少ないか

> 【0014】そのため、この発明では、より精度の高い バッグ法測定が可能となった。

【0015】一方、ガス分析計17およびトレースガス を用いたモーダルマス解析から、排ガス中の測定対象成 分の排出重量も求めることができる。すなわち、ガス分 析計17を用い、所定の走行モード切り換えシーケンス に基づいておこなわれる走行シュミレーション試験に供 される自動車1から排出される排ガスに混合させてある トレースガスの既知の導入量QH(t)と、一定のサンプ 50 リングタイムで計測したトレースガスの濃度C<sub>B</sub>(t)と

5

から、上述したように

 $Q_{DE}(t) = Q_{H}(t) \div C_{H}(t) \cdots \bigcirc$ 

なる演算式より排ガスの流量QDE (t)を求める一方、トレースガスの濃度CH(t)の計測と同じ一定のサンプリングタイムで、排ガス中の測定対象成分の濃度CDE(t)を計測し、

 $M(t) = \rho \times C_{DE}(t) \times Q_{DE}(t) \cdots \quad \bigcirc$ 

(ここに、pは測定対象成分の密度)

なる演算式より測定対象成分の排出重量M(t) を走行モード毎に求めることができる。

【0016】よって、この発明では、モーダルマス法と前記バッグ法とのデータの相関も求めることができる。 【0017】更に、モーダルマス法では以下の利点を有する。すなわち、希釈空気を用いないので、希釈空気中に含まれている特定成分の影響がなく、また、面倒な排気ガスの温度や圧力の補正が不要であり、かつ、排気ガスの脈動の影響を受けにくい。

【0018】また、トレースガス検出器16とガス分析計17を並列に配置してあるので、双方に排ガスを同一タイミングで導入させることができ、トレースガス検出 20器16によって計測される排ガスの流量QDE(t)と、ガス分析計17によって計測される測定対象成分の濃度CDE(t)とが同一のタイミングで求められるため、双方の時間調整が不要となる。

【0019】更に、CVS装置や空気精製機が不要であることによってレイアウトの自由度が向上し、装置をコンパクト、かつ、コスト安に提供することができる。また、CVS装置を用いないので、暖気を必要としない利点もあり、ランニングコストの大幅な低減化も可能となる。

【0020】そして、トレースガスを用いたモーダルマス解析方法では、ドライベースの濃度CDE(t) に直接乗算できるドライベースの流量QDE(t)をトレースガス検出器16で実調することができるため(②式参照)、前記②における演算過程では、除湿装置12で除去された排ガス中の水分量の仮定値を用いることなく精度のよい測定値を信頼性よく求めることができる(例えば、特願平10-48884号参照)。

【0021】なお、トレースガス供給路30を図1において仮想線30′で示すようにエンジン2の吸気側に接続してもよい。

[0022]

【発明の効果】上述のように、この発明では、内燃機関 に連なる排気流路から定流量でサンプリングした排ガス の一部を希釈ガスで希釈する流量信号源としてガストレ ース法を用いるとともに、サンプリング流路の希釈ガス 導入点よりも下流側に、マスフローコントローラ、トレ 10 ースガスの濃度を測定するトレースガス検出器および前 記排ガス中の測定対象成分を計測するためのガス分析計 を互いに並列に設けるたので、モーダルマス計算から測 定対象成分の排出重量を求めることができるとともに、 マスフローコントローラのガス出口にサンプルバッグを 接続してマスフローコントローラにトレースガスの濃度 値をフィードバックし、このマスフローコントローラで の流量調整により希釈された排ガスを排ガスの流量に比 例した流量でサンプルバッグにサンプリングするよう構 成したので、希釈空気を用いるCVS装置で行っていた バッグ法のデータをCVS装置を用いることなく得るこ とができるとともに、より精度の高いバッグ法測定が可 能となる。

【0023】また、モーダルマス法とバッグ法とのデータの相関も求めることができる。

【0024】また、希釈空気を用いるCVS装置で行っていたバッグ法で問題となっていた水分捕集による体積減少に伴う濃度誤差を考慮する必要がなくなる。

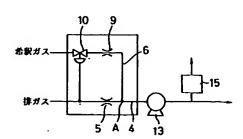
【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施形態を示す構成説明図であ 30 る。

【図2】上記実施形態における要部構成説明図である。 【符号の説明】

3…排気流路、4…サンプリング流路、5…臨界流量オリフィス、6…希釈流路、13…吸引ポンプ、15…マスフローコントローラ、15a…ガス出口、16…トレースガス検出器、17…ガス分析計、20…サンプルバッグ、21…CPU、A…希釈ガス導入点。

【図2】



【図1】

